

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ETCHING DI VAPORI DI ACIDO FLUORIDRICO DA INSTALLARE PRESSO LA CLEAN ROOM MEMS DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER.

La Fondazione Bruno Kessler nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità rende nota la propria esigenza di procedere all'acquisizione di un sistema di etching di vapori di acido fluoridrico per rimuovere ossidi di silicio in strutture MEMS.

L'affidamento si inserisce nel contesto del Programma Operativo 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha approvato l'avviso "Sostegno alle infrastrutture di ricerca" - Programma Operativo 2014-2020 FESR - Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» - Azione 1.1.1 - «Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» - Avviso 5/2017.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all'affidamento.

Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti.

La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Fondazione la disponibilità ad essere selezionati al fine di partecipare alla procedura negoziata che sarà effettuata sul portale MEPA gestito da CONSIP spa.

*** ***** ***

1. OGGETTO:

La fornitura ha per oggetto un sistema di etching in vapori di acido fluoridrico (HF). Il sistema serve per rimuovere ossidi di silicio sepolti in strutture MEMS in maniera selettiva rispetto a silicio, alluminio, nitruro di silicio e altri materiali, evitando che la condensazione dei reagenti porti a incollaggio per tensione capillare tra la struttura rilasciata e il substrato. Le fette di silicio utilizzate hanno un diametro di 150mm

L'apparecchiatura sarà collocata presso la clean room MEMS della Micro-nano Characterization and Fabrication Facility, Fondazione Bruno Kessler di Trento, in via Sommarive 18 ed avere le seguenti caratteristiche:

- essere composta da materiali e componenti nuovi. Sono escluse apparecchiature e componenti usati e ricondizionati.
- comprendere un sistema di allarme in caso di fuoriuscite di vapori di HF.
- essere in grado di processare fette da 150 mm, con possibilità di potenziare a 8 pollici.
- avere la possibilità di caricare campioni (chips) di varie dimensioni.
- avere una pressione di lavoro della camera di reazione inferiore ai 200 Torr.
- essere predisposta per l'installazione di eventuali moduli di potenziamento se disponibili.
- comprendere il sistema di pompaggio in vuoto.

- poter utilizzare come strati protettivi alluminio, allumina e oro.
- avere dimensioni massime di 100 (base) x 100 (profondità) x 200 (altezza) cm.

Sarà inoltre richiesta la disponibilità di parti di ricambio per almeno 7 anni.

2. DURATA:

La strumentazione dovrà essere consegnata nel termine di 150 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

3. VALORE STIMATO:

Importo presunto € 190.000,00 oltre IVA di legge.

4. REQUISITI RICHIESTI:

- Assenza cause esclusione dalla partecipazione alle gare ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- Aver venduto nell'ultimo triennio (2016-2018) strumentazione analoga a quella in oggetto per un importo almeno pari alla base di gara.

5. CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Per l'affidamento verrà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate compilando il modulo on-line al seguente link <http://appalti.fbk.eu/it/manifestazione-di-interesse-lavori-servizi-e-forniture> entro non oltre il giorno mercoledì 14 aprile 2019 alle ore 23.59.

Per lo svolgimento della procedura di gara, FBK intende avvalersi del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* messo a disposizione da Consip Spa (MEPA). Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è quindi necessaria la registrazione a tale sistema nel bando Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica, selezionabile sul sito <https://www.acquistinretepa.it/>.

Si precisa che gli operatori economici da invitare alla procedura di gara saranno individuati da FBK in base ad un giudizio di idoneità che terrà conto delle capacità tecnico-professionali sopra richieste.

Si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR).

Per eventuali chiarimenti e per la richiesta di sopralluogo scrivere a gare@fbk.eu.

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Paola Angeli.

Trento, lì 29 marzo 2019

Paola Angeli
Responsabile del Servizio Appalti e Contratti
(F.to digitalmente)